

真空鍍膜實驗報告(重修)

1. 請詳細描述何謂真空鍍膜系統？
2. 如何利用真空放電管測漏並簡述其原理。
3. 如何由光譜儀所觀察之穿透光譜圖判定 n 、 k 、 d 的大小。
4. 如何利用橢偏儀量測出 n 、 k 、 d 的值。
5. 試問在 Macleod 軟體中，膜層變化而導致光譜圖的差異，是何因素造成的結果？
6. 請簡述熱蒸鍍法、電子槍蒸鍍法及磁控濺鍍法之原理，其中請說明磁控濺鍍法中 RF 與 DC 之適用條件。(請重點描述)

※報告請附上封面(報告名稱、姓名、系級、學號)，內文請使用標楷體、Times New Roman，字體大小 14 pt。

報告請於 2010/12/31 前 mail 至 497598028@mail.fju.edu.tw